

平成 29 年 5 月吉日

展示・発表者 各位

公益社団法人 日本表面科学会

会長 大門 寛

公益社団法人 日本表面科学会 関東支部

支部長 藤田大介

**「実用顕微評価技術セミナー 2017」
ポスター展示・発表、参加費納入、参加者登録等のご案内**

このたびは、表記セミナーに展示・発表の参加申込みを頂き、誠に有難うございます。いよいよ表記セミナーの開催が迫ってまいりました。ポスター展示・発表、参加費納入、参加者登録の要領につきご案内申し上げます。なお、本セミナー開催につきましては、現在も学協会誌、学会ホームページなどを通じて広報を行っておりますが、貴社からも参加者の勧誘などご協力を賜りますよう、合わせてお願い申し上げます。

開催日時：2017年6月16日(金) 10:00~17:30

1. ポスター展示

(1) 小間

ポスターボードは幅 112cm×高さ 172cm のものが1枚です。ただし、ボードの前に展示用テーブル(高さ 70cm)を設置しますので、ボードの有効高さは 100cm 程になります。ボード上部には帯状の社名札を貼付する予定です。ポスターは画鋸もしくはピン止めとします。展示用テーブルを1台用意いたします。大きさは、長さ 180cm×幅 45cm×高さ 70cm ですが、当日の使用状況により一部、長さ 150cm のものしか用意できない場合がありますことをご了承願います。

(2) 電源

各小間には電源は付属しておりません。パソコンによる展示等、電源ご希望の方は、予め学会事務局までお申し出下さい。

(3) 展示物等

会場は当日 9:30 開場の予定です。各社におかれましては、セミナー開始時間の 10:00 までに、展示のご準備をお願いします。ポスターや展示物はあらかじめ宅配等で送付して頂くことも可能です。荷物は前日の 6 月 15 日(木) 午後着の指定でご送付いただき、荷物伝票には必ず個数と《6/16 顕微セミナー分》を明記下さい。なお、セミナー終了後に宅配便集荷を一括手配いたしますが、手続きは各社の責任でお願いいたします。

●荷物送付の場合の送り先：

〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1

東京大学大学院理学系研究科化学専攻

化学西館 4 階 2 4 0 6 A 号室 (長谷川哲也研究室) TEL 03-5841-4353

《6/16 顕微セミナー分》と個数を明記のこと

2. ショートプレゼンテーション

使用可能な機材は液晶プロジェクターです。発表時間は 10 分とします。例年、液晶プロジェクターとパソコンの同期不具合によるトラブルが数件発生しております。できる限りプレゼン資料を USB メモリーか CD-ROM に保存してご持参下さい。ご自身のパソコンを利用される場合は、早めに会場にお越しいただき不具合のないよう確認をお願いいたします。

3. 参加費納入

請求書を別途、郵送いたします。可能な限り事前に所定の口座にお振込み下さい。

4. 参加登録

各社の聴講参加は何名でも無料ですが、必ず全員の参加者名を下記の web ページから予めご登録下さい。

<http://www.sssj.org/jpn/activities/06/detail.php?eid=00014>

5. 交流会

セミナー終了後に、発表・展示参加各社の交流を目的に、簡単な交流会(名刺交換会)を開催することを計画しております。上記で参加登録された展示企業の方は無料でご招待いたしますので、是非ご参加下さい。

6. プログラム

発表タイトルをご確認下さい。間違い、変更がありましたら至急ご連絡下さい。また、発表時間にご都合がつかない場合は、ご相談下さい。

時間	企業・機関名	発表タイトル	発表者	
10:00～ 11:40	プレゼンテーション シヨート	オックスフォード・ インストゥルメンツ(株)	毎秒10 フレームの超高速イメージング能力と高い操作性・ 多機能性を兼ね備えたCypher VRS AFM の紹介	出口 匡
		(株) 日本サーマル・ コンサルティング	AFM-IR の開発現状と応用	小林 華栄
		(株) 日立ハイテクノロジーズ	SEM-AFM 相関解析手法 (SEMic.)によるソリューション	水口 勝利
		(株) ユニソク	超高真空、低温の優位性を活かした SPM 実用例	小澤 太健展
		シエンタ オミクロン(株)	超高真空 SPM 新製品のご紹介	富塚 仁
		パーク・システムズ・ ジャパン(株)	AFM における真のノンコンタクト計測技術と初心者でも高精度 AFM 計測を可能とする新型オペレーションソフトウェアの紹介	出口 大介
		(株)島津製作所	高分解能走査型プローブ顕微鏡 HR-SPM による 固液界面観察	新井 浩
11:40～ 13:00	ポスターセッション・展示／昼食休憩			
13:00～ 14:00	特別講演「共焦点光学系を利用した超解像顕微鏡の原理と実装」 岡田 康志先生(東京大学大学院 理学系研究科)			
14:00～ 14:15	休憩			
14:15～ 16:00	プレゼンテーション シヨート	アメテック(株)	イオン顕微鏡 NanoSIMS50L による高感度元素分析事例	石川 真起志
		日本電子(株)	観たい領域をピンポイントで SEM 観察 ～OM・SEM リンクシステムの紹介～	鈴木 克之
		(株) コベルコ科研	走査電子顕微鏡 (SEM) を用いた微細組織の結晶方位解析 (SEM-TKD 法)	徳谷 恭子
		物質・材料研究機構	高輝度・高スピン偏極低エネルギー電子顕微鏡による 実時間磁区観察	鈴木 雅彦
		レニショー(株)	曲面・粗面の顕微ラマンイメージングが切り拓く材料評価の 応用事例	三澤 真弓
		(株) テックサイエンス	IR 光誘起力顕微鏡【PiFM】を用いたナノケミカル イメージング	小野寺 毅師
		(株) ニコンインステック	光干渉法による 0.1nm 級超平滑面の表面性状測定について	西川 孝
		(株) 東陽テクニカ	元素分析の新提案～イメージング XRF～	岩田 敏一
16:00～ 17:30	ポスターセッション・展示			

以上

問合せ先：日本表面科学会関東支部役員 鷺坂恵介（物質・材料研究機構）

E-mail: SAGISAKA.Keisuke@nims.go.jp